

Endpoint Detection

Plasma Solution by OES



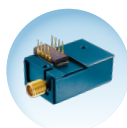
iHR320/550



M116



EV 2.0 Series



VS-20

R&D

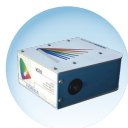
Mass Production



VU90



OES-Star



VS-70

プラズマの分布を
可視化したい

マルチチャンネル分光器※にて
空間分布が計測可能

※ 最大16チャンネル



M116

真空紫外の未知の
反応種を可視化したい

真空紫外専用の分光器にて
115nm～の計測を実現



VU90

低開口率プロセスの
EPDを高精度化したい

専用解析ソフト付き
又は、高感度モデルで実現



EV 2.0 Series



OES-Star

Contact

アプリケーションデータ、ソリューション事例へ
のお問合せはこちら

